文章编号: 0258-7025(2004)Supplement-0164-02

飞秒激光制备折射率调制光栅及分析

郭亨长, 王 曦, 方 瀛, 彭 超, 杨 宏, 蒋红兵*, 龚旗煌 (北京大学物理学院现代光学研究所,人工微细结构和介观物理国家重点实验室, 北京 100871)

摘要 利用飞秒激光(120 fs, 810 nm, 1 kHz)线扫描方法在石英玻璃体内形成折射率调制型光栅结构。研究光栅结构折射率调制 度 Δn 与飞秒激光脉冲能量、扫描速度和扫描重复率等参量的关系。多次扫描的光栅结构 Δn 提高到 3×10^{-3} 。说明积累效应对折射 率调制结构的形成起重要作用,并解释以往得到 Δn 大小不同的原因。

 关键词
 应用光学;折射率调制光栅;飞秒激光微制备;石英玻璃

 中图分类号 O437
 文献标识码 A

Fabrication of Refractive Index–Modulated Grating in Fused Silica by a Femtosecond Laser

GUO Heng-chang, WANG Xi, FANG Ying, PENG Chao, YANG Hong, JIANG Hong-bing^{*}, GONG Qi-huang

(State Key Laboratory for Mesoscopic Physics and Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract The refractive index-modulated grating, performed by line scan in fused silica with a femtosecond laser at wavelength of 810 nm and repetition rate of 1 kHz, were presented. Dependence of the refractive index-modulation on femtosecond laser pulse energy, scan speed, spacing period, and scanning repetitions was investigated. The refractive index modulation reached to 3×10^{-3} after several scanning repetitions. It was revealed that the accumulation effect played a very important role in the formation of refractive index-modulated structures.

Key words applied optics; index-modulated grating; femtosecond laser microfabrication; fused silica

1引言

超短激光脉冲在透明电介质材料体内通过多光 子吸收等非线性光学过程,可以引起折射率变化并 用来实现三维微制备^[L2]。自 1996年日本京都大学利 用近红外飞秒激光在玻璃体内形成折射率调制的光 波导^[8]以来,飞秒激光微制备工作得到了广泛关注。 在光信息处理和集成光学器件方面已经开展了一系 列应用研究,如:光波导^[8-6]、耦合器^[7-9]、光栅^[10]和微 透镜^[11]等方面。然而,以往报道折射率调制度(Δn)范 围从 10⁻⁶到 10⁻²变化,存在极大的差别^[2-11]。本文利 用显微物镜(4×,NA=0.1)聚焦飞秒激光在石英体内 制备光栅结构,研究飞秒激光脉冲能量、扫描速度和 重复扫描次数等制备参量对 Δn 的影响。采用积累 效应解释以往得到 Δn 大小不同的原因。为飞秒激 光在透明电介质材料体内微制备的过程中更好地控 制微结构的形成提供依据。

2 光栅结构的制备及 Δn 的测量

实验系统采用飞秒激光器,波长 810 nm,重 复率 1 kHz,脉宽 120 fs。激光束经空间滤波后由 显微物镜(4×,NA=0.10)聚焦到石英玻璃(10 mm× 5 mm×3 mm)体内,并产生成丝形微结构。飞秒激 光沿 Z 轴方向传输,光栅结构通过控制三维平移台 的运动参量进行扫描。

光栅结构如图 1 所示,其周期为 5.3 μm,光栅 厚度 50 μm。实验中扫描速度为 10 μm/s,脉冲能量 1.2 μJ,每条线型结构均由 X 方向扫描形成。利用三 维平移台让样品垂直于激光束移动,激光束自陷传 播在样品内产生的折射率变化长丝在样品内来回 移动,从而形成线状的折射率调制结构。由于成丝 长度较长,在 XY 截面和 YZ 截面都可以用于衍射。

为测量光栅结构的 Δn,实验中采用 He-Ne 激 光入射到光栅的 YZ 面,再利用公式(1)进行推算得

基金项目: 自然科学基金项目资助(10104003,90101027,50173031)

作者简介: 郭亨长(1977-),男,北京大学物理学院博士生,主要从事飞秒激光与透明电介质相互作用及微结构制备方面的 研究。E-mail:hcguo@water.pku.edu.cn。*通信联系人,E-mail: hbjiang@pku.edu.cn



图 1 石英体内光栅结构和衍射图形,空间周期 5.3µm (a) XY 截面的光栅图像; (b) YZ 截面的成丝图像

Fig.1 Optical image of the fabricated grating observed by a microscope. Spacing period of the grating is 5.3 µm

(a) XY section plane of the grating; (b) YZ section plane of the grating

到 △n^[12]。

$$\Delta n = \frac{\lambda}{\pi d} \cos\theta_1 \arcsin\sqrt{\eta} \tag{1}$$

其中, λ 为 He-Ne 激光波长(632.8 nm),d为光栅厚度(50 μ m), η 为1级 Bragg 衍射效率, θ_1 为相应入射角。实验对 Δn 和周期关系进行描述。测得当周期在 5.2~5.5 μ m 范围时, Δn 比较大。以下实验分析所制备光栅的周期均在此范围内。

3 积累效应对 Δn 的影响

3.1 激光脉冲能量等参量对成丝长度的影响

采用低数值孔径的透镜聚焦制备光栅结构,往往 需要控制成丝长度。如图2所示,脉冲能量在3.5μJ 以下,聚焦飞秒激光在石英玻璃体内的成丝长度随 脉冲能量增加呈线性上升。而脉冲能量不变,改变 扫描速度时,成丝长度随速度增加呈线性递减。成 丝长度的变化认为是积累效应在起作用。





3.2 脉冲能量、扫描速度和扫描重复率对 Δn 的影响

实验研究发现在破坏阈值以下,Δn随脉冲能 量增加而增加。在同样的脉冲能量,Δn随扫描速度 的提高呈线性递减关系。

单次扫描时,得到的 Δn 往往比较低。当扫描速 度为 10 μ m/s,脉冲能量为 1.2 μ J 时,单次扫描得到 光栅 Δn 约 2.3×10⁻⁴。重复扫描 20 次, Δn 可提高到 3×10⁻³。当扫描次数继续增加时, Δn 也随之增加并趋 于饱和。因为飞秒激光聚焦到石英体内,导致晶格 温度升高,而低重复率的飞秒激光器使得积累有限 而趋于平衡值。所以制备折射率调制结构时,多次 重复扫描可以大幅度地提高 Δn 。扫描速度不同,控 制扫描重复率,发现在曝光能量相同时低速扫描 Δn 比较高。我们认为积累效应对制备结构的 Δn 形 成起作用,并解释以往所报道 Δn 结果不同的原因。

参考文献

- 1 A. M. Streltsov, N. F. Borrelli. Study of femtosecond-laserwritten waveguides in glasses [J]. J. Opt. Soc. Am. B, 2002, 19: 2496~2504
- 2 K. Yamada, W. Watanabe, T. Toma. In situ obervation of photoinduced refractive-index changes in filaments formed in glasses by femtosecond laser pulses[J]. Opt. Lett., 2001, 26: 19-21
- 3 K. M. Davis, K. Miura, N. Sugimoto. Writing waveguides in glass with a femtosecond laser [J]. Opt. Lett., 1996, 21: 1729–1731
- 4 M. Will, S. Nolte, B. N. Chichkov. Optical properties of waveguides fabricated in fused silica by femtosecond laser pulses [J]. Appl. Opt., 2002, 41: 4360~4364
- 5 A. Saliminia, N. T. Nguyen, M. -C. Nadeau. Writing optical waveguides in fused silica using 1 kHz femtosecond infrared pulses [J]. J. Appl. Phys., 2003, 93: 3724~3728
- 6 J. W. Char, T. Huser, S. Risbud. Structural changes in fused silica after exposure to focused femtosecond laser pulses [J]. Opt. Lett., 2001, 26: 1726~1728
- 7 D. Horocelle, S. Wielandy, A. L. Gaeta. Infrared photosensitivity in silica glasses exposed to femtosecond laser pulses [J]. Opt. Lett., 1999, 24: 1311~1313
- 8 A. M. Streltsov, N. F. Borrellie. Fabrication and analysis of a directional coupler written in glass by nanojoule femtosecond laser pulses [J]. Opt. Lett., 2001, 26: 42~43
- 9 J. W. Chan, T. R. Huser, S. H. Risbud. Waveguide fabrication in fused silica using tightly focused femtosecond laser pulses [C]. *SPIE*, 2002, **4640**: 129~136
- 10 L. Sudrie, M. Franco, B. Prade. Writing of permanent birefringent microlayers in bulk fused silica with femtosecond laser pulses [J]. Opt.Commun., 1999, 171: 279–284
- 11 E. Bricchi, J. D. Mills, P. G. Kazansky. Birefringent Fresnel zone plates in silica fabricated by femtosecond laser maching [J]. *Opt. Lett.*, 2002, 27: 2200–2202
- 12 H. Kogelnik. Coupled wave theory for thick hologram gratings [J]. The Bell System Techical Journal, 1969, 48: 2909–2947